

卓上型局所吸引プラズマエッチング装置「TP-50B」

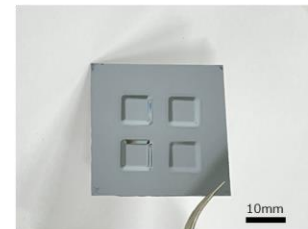
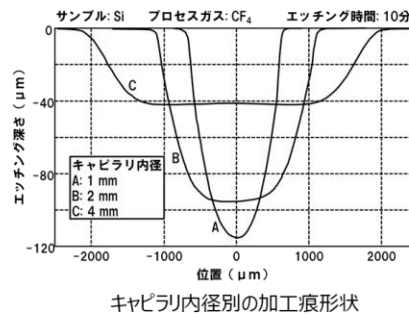
(株式会社三友製作所) 岩瀬 千克

キーワード: 吸引プラズマ, 局所加工, 表面改質, エッチング, クリーニング

卓上型局所吸引プラズマエッチング装置

TP-50B

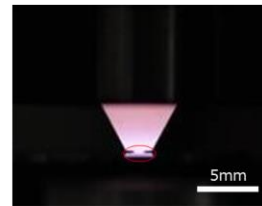
TP-50B本体



スキャン機能によるトレンチ加工

特徴

- ・卓上サイズでコンパクト(240(W)×456(D)×360(H))
- ・局所的なプラズマ加工が可能(ϕ 0.5mm~ ϕ 4mm)
- ・低残渣かつ高速加工が可能(10 μ m/min)
- ・スキャン加工による広範囲加工が可能(28mm×28mm)



局所プラズマ発生の様子(ϕ 1mm)

多様なプラズマ加工に対応

独自のプラズマ発生技術により局所領域でのプラズマ処理が可能！

様々な応用が可能な卓上サイズのプラズマエッチング装置になります。

- ・ **表面改質** (被加工材の任意のポイントにプラズマを照射することで材料表面の親水性を付与)
- ・ **エッチング** (Si や SiO₂、SiC 等の材料を任意の形状にエッチング可能)
- ・ **クリーニング** (有機膜の除去やレジスト膜の除去(アッシング)が可能)

メッセージ

- ・局所吸引プラズマのデモ加工を受け付けております。お気軽にお声がけ下さい。※初回のみ無償対応
- ・異なるアプリケーションへの応用など、共同研究できる方を募集しております。
- ・自社製品に関わるご不明点やプラズマ装置以外のコラボレーション等も受け付けております。